

エリプソメータ

基板上に形成された膜の厚さ及び屈折率等の測定

【型式】

（株）溝尻光学工業所 DVA-36L3

【仕様】

測定波長：632.8nm（He-Ne レーザ）

試料サイズ：直径 75mm（最大）

膜厚測定範囲：0～数 μm

【設置年度】

1994 年度（平成 6 年度）



○ 設備・機器に関してのご質問，設備利用の手続き等は，[センター](#)の電話番号にお問い合わせください。設備利用の利用手続き等は[設備利用のページ](#)でご確認ください。

令和 4 年 7 月 26 日